

○経済産業省令第二十一号

輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十年三月二十六日

経済産業大臣 甘利 明

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）の一部を次のように改正する。

第一条第七号中「ウラン」の下に「若しくはプルトニウム」を加え、同条第十七号ロ（三）中「該当するもの」の下に「（フィードバック機能を有しない干渉計であつて、レーザを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するものスライド運動誤差を測定するものを除く。）」を加え、同条第三十八号イ（一）及び（二）を次のように改める。

(一) フルスケールが十三キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス一パーセント未満のもの

(二) フルスケールが十三キロパスカル以上であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの

第二条第一項第一号中ウを削り、ムをウとし、ラをムとし、ナをラとし、同号ネの次に次のように加える

ナ 亜リン酸トリイソプロピル

第二条の二第一項第二号中「牛肺疫菌」の下に「(小コロニー型)」を、「マルタ熱菌」の下に「、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株」を加える。

第三条第三号口中「ロケット又は」の下に「ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる」を加え、同条第七号に次のように加える。

オ ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール

第三条第十六号口及びハ中「五〇〇キログラム以上の」を削り、「ロケット又は」の下に「五〇〇キログ

ラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる」を加え、同号二を次のように改める。

ニ ロケット又は無人航空機のレードーム（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）に使用するためのセラミックの複合材料（一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。）

第三条第十六号ト中「五〇〇キログラム以上の」を削り、「ロケット又は」の下に「五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる」を加え、同号中トをチとし、同号へ中「五〇〇キログラム以上の」を削り、「ロケット又は」の下に「五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる」を加え、同号中へをトとし、同号ホ中「五〇〇キログラム以上の」を削り、「ロケット又は」の下に「五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる」を加え、同号中ホをへとし、同号中ニの次に次のように加える。

ホ ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料

第三条第十七号中「若しくは航法装置」を「航法装置若しくは磁気方位センサー」に改め、同号イ中「五〇〇キログラム以上の」を削り、同号ハ中「再現性が」の下に「一年間につき」を加え、同号に次のように加える。

ト 磁気方位センサーであつて、次の（一）から（三）までのすべてに該当するものうち、軸数が三のもの

（一） ピッチ角（プラスマイナス九〇度）及びロール角（プラスマイナス一八〇度）の内部傾き補正を有するもの

（二） 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの

(三) 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの

第三条第十七号の三中「若しくは校正装置、」を「、校正装置若しくは」に改め、同条第十九号の次に次の一号を加える。

十九の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であつて、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの

第三条第二十五号中「(それぞれ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。))又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。」を削り、同号イ中「該当するもの」の下に「(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。))又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。」を加え、同号ロ中「風洞」の下に「(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット

ト若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。」を加え、同号ハ中「九〇」を「六八」に改め、「測定することができるもの」の下に「(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。 ) 又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。 )」を加え、同号ニ中「該当するもの」の下に「(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。 ) 又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。 )」を加え、同号ホ中「除く」を「除き、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。 ) 又は同号ロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る」に改め、同条第二十六号中「(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬する

ことができるロケットに使用することができるものに限る。」を削る。

第四条第四号へを次のように改める。

へ 非破壊検査装置であつて、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一) 三次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置

(二) 数値制御を行うことができる超音波検査装置であつて、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の三次元輪郭を軸数が四以上で測定するよう調整されているもの

第四条第十号イ中「複数の」を削り、「次のいずれかに該当するもの」を「次の(一)及び(二)に該当するもの」に改め、同号ロ(一)中「二四九・一六度未満」を削り、同号ロ(三)を次のように改める。

(三) 超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるものであつて、臨界電流密度がすべての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの

第四条第十号に次のように加える。

ハ 超電導ファイラメントからなる超電導材料であつて、零下一五八・一六度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの

第四条第十三号口中「一・八二」を「一・八〇」に改め、同号ハを次のように改める。

ハ 削除

第五条第二号イ中「(コンタクトレンズの製造用に設計したものを除く。)」を削り、同条第四号中「行うことができる」の下に「光学仕上げ」を加え、「磁性流体研磨法を用いるもの」を「非球形な光学的表面に加工することができるものうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。

イ 仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のもの

ロ 仕上げの表面粗さの二乗平均が一〇〇ナノメートル未満のもの

ハ 輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの

ニ 次のいずれかの方法を用いるもの



(一) 磁性流体研磨法

(二) 電気粘性流体研磨法

(三) エネルギー粒子ビーム研磨法

第五条第十号イを次のように改める。

イ フィードバック装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 直線上の位置を検出する位置検出器を有するものであつて、当該装置の精度が位置検出器のミリメートルで表したスケールの有効長さの十万分の六パーセントに $0.0008$ ミリメートルを加えて得た数値未満のもの

(二) 第一条第十七号ロ (三) に該当する測定装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

第六条第一号ハ中「であつて、次のいずれかに該当するもの」を「のうち、化合物半導体を用いたものであつて、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるもの」に改め、(一) から(三) までを削り、同号ホ(一) 3中「五〇」を「一〇五」に改め、同号ホ(一) 4中「五」を「一〇」に改め、同号ホ(一) 5中

「一メガ」を「二・五メガ」に改め、同条第二号ニ中「マイクロ波用」の下に「ディスクリート」を加え、同号ホ（六）中「三」を「三・二」に改め、同号に次のように加える。

ル マイクロ波用電力モジュールであつて、進行波管、マイクロ波用モノリシック集積回路及び電源を有するものうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

（一） 完全停止状態から完全作動状態までの時間が一〇秒未満のもの

（二） 体積が、ワットで表した最高定格出力値に一〇立方センチメートル毎ワットを乗じて得た数値未満のもの

（三） 一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 周波数が一八ギガヘルツ以下のものにあつては、無線周波数の出力が一〇〇ワットを超えるもの

2 周波数が一八ギガヘルツを超えるもの

第六条第五号を次のように改める。

五 セルであつて、次のいずれかに該当するもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

イ 一次セルであつて、二〇度の温度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラムを超えるもの

ロ 二次セルであつて、二〇度の温度におけるエネルギー密度が二五〇ワット時毎キログラムを超えるもの

第六条第七号の次に次の一号を加える。

七の二 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであつて、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで一、三六七ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、二八度の動作温度において二〇パーセントを超えるもの（他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

第六条第八号の次に次の一号を加える。

八の二 パルス出力の切換えを行うサイリスタデバイス又はサイリスタモジュールであつて、電氣的に若しくは光学的に制御された切換え方法又は電子の放射を制御された切換え方法を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの（民生用の鉄道又は航空機用に設計された装置に組み込まれたもの及び

他の貨物に使用するように設計したものを除く。）

イ 最大立上がり電流が三〇、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであつて、休止状態電圧が一〇〇ボルトを超えるもの

ロ 最大立上がり電流が二、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであつて、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一） 休止状態電圧が三、〇〇〇ボルト以上のもの

（二） 最大電流が三、〇〇〇アンペア以上のもの

第六条第十三号中「基準周波数」を「基準参照発振器」に改め、同号ハを次のように改める。

ハ 次のいずれかに該当するもの

（一） 周波数切換え所要時間が一〇ナノ秒未満のもの

（二） 三・二ギガヘルツ超一〇・六ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、一・六ギガヘルツを超えるあらゆる周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

（三） 一〇・六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五五〇メガヘルツ

を超えるあらゆる周波数切換えの所要時間が二五〇マイクロ秒未満のもの

(四) 三一・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五五〇メガヘルツ

を超えるあらゆる周波数切換えの所要時間が五〇〇マイクロ秒未満のもの

(五) 四三・五ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲で、周波数切換えの所要時間が一ミリ秒未

満のもの

第六条第十七号イ(一)を次のように改める。

(一) 七五ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満の

シリコン以外の膜を形成できるもの

第六条第十七号へ中(二)を(三)とし、(一)の次に次のように加える。

(二) インプリントリソグラフィ装置であって、一八〇ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの

できるもの

第六条第十七号ト(一)中「第八号」を「第八号の二」に改め、同号ト(二)の次に次のように加える。

(三) 第一号から第八号の二までのいずれかに該当する集積回路の製造用のインプリントリソグラ

## フィテンプレート

第六条第十九号イ中「三五〇」を「二四五」に改め、同条第二十一号の次に次の一号を加える。

二十二 炭化けい素ウエハーであつて、電気抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもの

第七条第三号ル中「(五)又は(五の二)」を「又は(五)から(五の四)まで」に改める。

第八条第一号中「又は監視用の方向探知機」を「監視用の方向探知機、通信妨害装置又は電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる

装置」に改め、同条第二号イ(一)中「又は3に該当するもの」を削り、同号イ(一)3を削り、同号イ(

二)中「該当するもの」の下に「(三)に該当するもの又は」を加え、同号イ(三)を次のように改める

。

(三) ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであつて、使用者によってチャンネル符号、ス

クランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

1 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

2 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

第八条第五号の二中「イからハまでのすべて」を「イ及びロ」に改め、同号イ中「一」を「一〇」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるものの

第八条第五号の二ハを削り、同号の次に次の二号を加える。

五の三 通信妨害装置であつて、セルラー移動通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

イ 無線アクセスネットワークの機能を装うもの

ロ 使用されている移動通信プロトコルを探知し、及びこれを利用するもの

五の四 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であつて、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反

射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの

第八条第七号中「、第五号若しくは第五号の二」を「若しくは第五号から第五号の四まで」に改め、同条第九号中「ニまで」を「ホまで」に、「ホからヌまで」を「ヘからルまで」に改め、同号ハ中「設計したものの」の下に「（二に該当するものを除く。）」を加え、同号ニ中「ウルトラワイドバンド技術」を「次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術」に、「又はスクランブル符号」を「スクランブル符号又はネットワーク認識符号」に改め、同号ニに次のように加える。

(一) 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

第八条第九号中ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トに次のように加える。

(五) 半導体デバイス又は集積回路の設計用のライブラリ、設計属性又は設計関連データを保護する暗号化、復号化又は暗号復号化機能

第八条第九号中トをチとし、ヘをトとし、同号ホ中「ヘからヌまで」を「トからルまで」に改め、同号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。



ホ 量子暗号を用いるように設計したもの

第九条第三号ニ及びホ中「二、五〇〇」を「三、〇〇〇」に改め、同条第九号の二中「（第六条第十七号に該当するものを除く。）」を削り、同条第十号イからニまでを次のように改める。

イ 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの（ニに該当するものを除く。）

(一) 一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであつて、定格出力が一ワットを超えるもの

(二) 一五〇ナノメートル以上五二〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、定格出力が三〇ワットを超えるもの（アルゴンレーザー発振器であつて定格出力が五〇ワット以下のものを除く。）

(三) 五二〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであつて、定格出力が五〇ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであつて、定格出力が一五〇ワットを超えるもの

(四) 五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもので

あつて、定格出力が三〇ワットを超えるもの

(五) 八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもので

あつて、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであつて、定格出力が五〇ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであつて、定格出力が八〇ワットを超えるもの

(六) 九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したも

のであつて、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

一 ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであつて、定格出力が一〇〇ワットを

超えるもの

二 定格出力が一五〇ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの（産業用レーザー発振器であつて、定格出力が二キロワット超六キロワット以下のものうち、総重量が一、二〇〇キログラムを超えるものを除く。）

一 ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、定格出力が五〇〇ワットを超えるもの

二 定格出力が二キロワットを超えるもの

(七) 一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が八〇ワットを超えるもの

(八) 一、五五五ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの

ロ 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの（二

に該当するものを除く。)

(一) 一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

2 平均出力が一ワットを超えるもの

(二) 一五〇ナノメートル以上五二〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が三〇ワットを超えるもの

2 平均出力が三〇ワットを超えるもの (アルゴンレーザー発振器であつて、平均出力が五〇ワット以下のものを除く。)

(三) 五二〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもので

あつて、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

二 平均出力が五〇ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一五〇ワットを超えるもの

二 平均出力が一五〇ワットを超えるもの

(四) 五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもので

あつて、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が三〇ワットを超えるもの

2 平均出力が三〇ワットを超えるもの

(五) 八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもので

あつて、次のいずれかに該当するもの

1 一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであつて、平均出力が二〇ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであつて、平均出力が五〇ワットを超えるもの

2 一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

- 二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの

(六) 九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 一ナノ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 ピーク出力が一パルス当たり五ギガワットを超えるもの

二 平均出力が一〇ワットを超えるもの

三 一パルス当たり〇・一ジュールを超えるパルスを発振するもの

2 一ナノ秒超一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに

該当するもの

一 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が一〇〇メガワットを超えるもの

ロ 平均出力が二〇ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数が一キロヘル

ツ以下になるように設計したもの

ハ ウオールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであつて、平均出力が一〇〇ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの

ニ 平均出力が一五〇ワットを超えるものであつて、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの

ホ 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 多重横モードで発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が四〇〇メガワットを超えるもの

ロ ウオールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであつて、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

ハ 平均出力が二キロワットを超えるもの

ニ 一パルス当たり四ジュールを超えるパルスを発振するもの

3 一 マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであつて、次のいずれかに該当する



もの

一 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの

ロ ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであって、平均出力が一〇〇ワットを超えるもの

ハ 平均出力が一五〇ワットを超えるもの

二 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が一メガワットを超えるもの

ロ ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

ハ 平均出力が二キロワットを超えるもの

(七) 一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計し

たものであって、次のいずれかに該当するもの

1 一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの

2 一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの

(八) 一、五五五ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のい

ずれかに該当するもの

1 一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

2 平均出力が一ワットを超えるもの

ハ 波長可変レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するものを除く。

(一) 六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

(二) 六〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり一ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が二〇ワットを超え

るもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの

(三) 一、四〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

ニ レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 半導体レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振する単一の半導体レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

一 一、五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一・五ワットを超えるもの

二 一、五一〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が五〇〇ミリワットを超えるもの

2 多重横モードで発振する単一の半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

一 一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの

二 一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二・五ワットを超えるもの

三 一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

3 単一の半導体レーザーアレイであって、次のいずれかに該当するもの

一 一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が八〇ワットを超えるもの

二 一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの

三 一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの

4 半導体レーザーアレースタックであって、3に該当するアレーを含むもの

(二) 一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五キロワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が五キロワットを超えるもの

(三) 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 持続波の定格出力が一五キロワットを超えるもの

2 一〇マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

- 一 平均出力が一〇キロワットを超えるもの
- 二 ピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
- 三 一〇マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振するものであつて、次のいずれかに該当するもの

- 一 一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二 平均出力が二・五キロワットを超えるもの

(四) エキシマレーザ発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

- 1 一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

- 一 一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二 平均出力が一ワットを超えるもの

- 2 一五〇ナノメートル超一九〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

- 一 パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二 平均出力が一二〇ワットを超えるもの

3 一九〇ナノメートル超三六〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

- 一 パルス当たり一〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

4 三六〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

- 一 パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二 平均出力が三〇ワットを超えるもの

(五) 化学レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

- 1 ふっ化水素レーザー発振器
- 2 ふっ化重水素レーザー発振器



3 トランスファレーザ発振器であつて、次のいずれかに該当するもの

一 酸素からの励起移動によつて励起するように設計したよう素レーザ発振器

二 ふつ化重水素からの励起移動によつて励起するように設計した二酸化炭素レーザ発振器

(六) ネオジウムガラスレーザ発振器（連続してパルスを発振するものを除く。）であつて、次のいずれかに該当するもの

1 一 マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり五〇ジュールを超えるパルスを発振するもの

2 一 マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり一〇〇ジュールを超えるパルスを発振するもの

第九条第十一号中「若しくは磁場勾配計」を「、磁場勾配計（医療用に設計したものを除く。）若しくは水中電場センサー（漁業用を除く。）」に改め、「（医療用に設計したものを除く。）」を削り、同条第十号又及びルを次のように改める。

又 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であつて、イからヌまでのいずれかに該当す

る貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したものを（ヨに該当するものを除く。）

ル 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であつて、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの

（一） ハに該当する磁力計であつて、ノイズレベルが二ピコテスラ未満を実現する光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したもの

（二） トに該当する水中電場センサー

（三） チからヌまでのいずれかに該当する磁場勾配計であつて、ノイズレベルが三ピコテスラ毎メートル未満を実現するもの

第九条第十一号中ルをヨとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トをチとし、への次に次のように加える。

ト 水中電場センサーであつて、一ヘルツの周波数で測定した場合のノイズレベルが八ナノボルト毎メートル未満のもの

第九条第十三号中「衝突防止用に設計した」を「民生用」に改め、同号イ中「平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号イに次のように加える。

(一) 平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの

(二) 距離の位置精度が一メートル以下であつて、方位角の位置精度が〇・二度以下のもの

第十条第一号を次のように改める。

一 加速度計であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

イ 直線加速度計であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 一四七・一五メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるよう設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 バイアスの安定性（校正後のものをいう。以下この条において同じ。）が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの

2 スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの

(二) 一四七・一五メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるよう設計した

ものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 バイアスの再現性が一年間につき〇・〇四九〇五メートル毎秒毎秒未満のもの

2 スケールファクターの再現性が一年間につき〇・二五パーセント未満のもの

(三) 慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであつて、九八一メートル毎

秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

ロ 角加速度計又は回転加速度計であつて、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用するこ

とができるように設計したもの

第十条第二号中「、角加速度計又は回転加速度計」を「若しくは角速度センサー」に改め、同条第二号イを次のように改める。

イ 九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであつて、

九・八一メートル毎秒毎秒の状態におけるドリフトレートの安定性が一月間で一時間当たり〇・五度

未満のもの

第十条第二号ハを次のように改める。

ハ 測定範囲が一秒当たり五〇〇度以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの

(一) ドリフトレートの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で三分間測定した場合に、一時間につき四〇度未満のもの

(二) 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・二度以下のもの

第十条第二号に次のように加える。

ニ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるよう設計したもの

第十条第三号の三の次に次の一号を加える。

三の四 第一号に該当する加速度計若しくは第二号に該当するジャイロスコープを組み込んだ慣性測定装置

(慣性計測ユニット及び慣性基準装置を含む。) 又はその部分品

第十条第七号を次のように改める。

七 水中ソナー航法装置であつて、船首センサーを組み込み、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその

の部分品

第十条第八号中「第六号」を「第七号」に改める。

第十一条第四号イに次のように加える。

(四) 第十二号に該当する材料を用いた部分品

第十二条第一号イを次のように改める。

イ 第二十五条第三項第二号イから又までのいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第五項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの。ただし、次のすべてに該当するものを除く。

(一) 本邦若しくは別表第二に掲げる地域の政府機関から認定されたもの

(二) 当該エンジンと一緒に、型式証明若しくは型式証明と同等の国際民間航空機関によって承認された文書を受けた民間航空機に使用するように設計されたもの

第十二条第十号の二を次のように改める。

十の二 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のイ又はロに該当するもの(娯楽又はスポーツの用に供する模型航空機を除く。)

イ 無人航空機であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 慣性航法装置による自動操縦等により、自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの

(二) テレビモニターによる遠隔操作等により、視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

ロ 無人航空機の部分品又は附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) イに該当する無人航空機を遠隔操作するように設計したもの

(二) 誘導装置又は制御装置（第十条に該当するものを除く。）であつて、イに該当する無人航空機に統合するように設計したもの

(三) 有人飛行機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの

第十二条に次の一号を加える。

二十 第十号の二に該当するものの製造用の装置

第十三条第二項第一号ホ及びへを次のように改める。

ホ 削除

へ 削除

第十三条第八項中第五号を次のように改める。

五 N―ノナノイルモルホリン

第十三条第八項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 ジフェニルアミンクロロアルシン（アダムサイト）

第十四条第五号ハ中「切換」を「切換え」に改め、同条第八号イ中「衝突防止用に設計した」を「民生用に改める。」

第十九条第三項第三号を次のように改める。

三 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであつて、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のものうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラム及び最小線幅が〇・一三マイクロメートル以上、かつ、金属層が五層以下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイクロコントローラのコアの



設計又は製造に必要な技術を除く。）

イ ベクトル演算器であつて、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に二を超えて実現できるように設計したもの

ロ 六四ビット以上の浮動小数点演算処理を一サイクル当たり二を超えて実現できるように設計したもの

ハ 一六ビットの固定小数点積和演算処理を一サイクル当たり四を超えて実現できるように設計したもの

第二十一条第二項第三号を次のように改める。

### 三 削除

第二十一条第二項第三号の二に次のように加える。

- (三) 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであつて、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものうち、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるよう設計したもの

第二十二条第二項第三号イ中「又は磁場勾配計」を「水中電場センサー又は磁場勾配計」に改め、同号ロ中「磁気異常」を「磁気又は水中電場の異常」に改める。

第二十三条第二項第二号中「第三号の二までのいずれか又は第四号」を「第四号までのいずれか」に改め、同条第四項第四号に次のように加える。

へ データベース参照航法装置であつて、水中での航行で使用することができるよう設計したもののうち、○・四海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの

第二十五条第一項第一号中「第十号まで又は第十一号から第十九号」を「第二十号」に改める。  
第二十五条第二項第三号に次のように加える。

ホ 第十二条第十号の二に該当するものを使用するために設計したプログラム

へ 航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するよう設計したプログラム

ト 次の(一)及び(二)に該当するプログラム

(一) 航空機用ガスタービンエンジンの空熱力、航空力又は燃焼状態を予測するように設計された

もの

(二) 実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空熱力、航空力又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの

第二十五条第三項第二号又中「であつて、スパン中間での支持がないもの」を削る。

第二十七条第三項第二号中「慣性航法データ」を「船首データ」に改め、同条中第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 外為令別表の一五の項（五の二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一 水中ソナー航法装置に用いることによつて、その装置を第十条第七号に該当するようになすことができるように設計したプログラム

二 船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによつて、その装置を第十条第七号に該当するようになすことができるプログラム（ソースコードのものに限る。）

イ ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ

ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ

ハ データベース参照航法装置からのデータ

別表第一を次のように改める。

#### 別表第一 削除

別表第二中「カナダ」の下に「、クロアチア」を、「デンマーク」の下に「、エストニア」を、「大韓民国」の下に「、ラトビア、リトアニア」を、「ルクセンブルク」の下に「、マルタ」を、「ロシア」の下に「、スロベニア、南アフリカ共和国」を加える。

#### 附 則

##### (施行期日)

1 この省令は、平成二十年五月十五日から施行する。

##### (罰則に関する経過措置)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。